**Левенец, Владислав Владимирович. Оптимизация методов химической подготовки и пассивации поверхности Si с применением фторсодержащих кислот : автореферат дис. ... кандидата технических наук : 05.27.06 / НИИ физ. проблем.- Москва, 1994.- 19 с.: ил. РГБ ОД, 9 94-2/2532-6**